STUDI TENTANG PENGARUH JARAK (SPACER) TERHADAP KUALITAS KRISTAL LAPISAN TIPIS $Sn(Se_{0,2}Te_{0,8})$ HASIL PREPARASI TEKNIK EVAPORASI VAKUM

STUDY ABOUT THE EFFECT OF SPACER TO CRYSTAL QUALITY $Sn(Se_{0,2}Te_{0,8})$ THIN FILMS PREPARATION RESULTS BY VACUUM EVAPORATION TECHNIQUE

Oleh:

Wida Afosma, Ariswan

w.wida234@gmail.com, ariswan@uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi jarak antara material sumber dengan substrat (spacer) terhadap kualitas kristal lapisan tipis, struktur kristal dan parameter kisi lapisan tipis, mengetahui morfologi permukaan dan kompoisi kimia lapisan tipis Sn(Se_{0,2}Te_{0,8}) yang terbentuk. Teknik yang digunakan dalam proses penumbuhan kristal pada pada penelitian ini adalah teknik Evaporasi Vakum. Penumbuhan lapisan tipis Sn(Se_{0,2}Te_{0,8}) dilakukan dengan variasi spacer. Untuk sampel 1 dengan spacer 10 cm, sampel 2 dengan spacer 15 cm dan sampel 3 dengan spacer 25 cm. Ketiga sampel lapisan tipis Sn(Se_{0.2}Te_{0.8}) ini dikarakterisasi menggunakan XRD (X-Ray Diffraction) untuk mengetahui struktur kristal dan parameter kisi, SEM (Scanning Electron Microscopy) untuk mengetahui morfologi permukaaan dan EDS (Energy Dispersive Spectroscopy) untuk mengetahui komposisi kimia lapisan tipis Sn(Se_{0.2}Te_{0.8}). Hasil karakterisasi XRD menunjukkan bahawa lapisan tipis Sn(Se_{0.2}Te_{0.8}) memiliki struktur kristal kubik. Nilai parameter kisi sampel 1 adalah a = 6,34 Å, sampel 2 adalah a = 6.38 Å dan sampel 3 adalah a = 6.40 Å. Hasil XRD menunjukkan bahwa variasi spacer dapat mempengaruhi kualitas kristal lapisan tipis. Intensitas paling tinggi ditunjukkan pada sampel 1 dengan spacer 10 cm, intensitas sedang ditunjukkan pada sampel 2 dengan spacer 15 cm dan intensitas paling rendah ditunjukkan pada sampel 3 dengan spacer 25 cm. Intensitas yang tinggi menunjukkan keteraturan letak atom-atom dalam kristal semakin baik. Hasil karakterisasi SEM menununjukkan bahwa kristal lapisan tipis $Sn(Se_{0.2}Te_{0.8})$ terdiri atas grain berbentuk kubik dan memiliki permukaan yang homogen terlihat dari bentuk dan warna kristal yang seragam. Pada sampel 1, butiran (grain) sebagian besar berukuran 0,3µm dan pada sampel 2, butiran (grain) sebagian besar berukuran 0,2 µm. Hasil karakteriasai EDS pada sampel 1 diperoleh perbandingan molaritas Sn: Se: Te adalah 1:0,29:0,58. Untuk sampel 2 diperoleh perbandingan molaritas Sn : Se : Te adalah 1 : 0,33 : 0,62.

Kata kunci: lapisan tipis $Sn(Se_{0.2}Te_{0.8})$, evaporasi vakum, preparasi, *spacer*.

Abstract

This study aimed to determine the effectf variation the distance between the source and the substance (spacer) to crystal quality thin films, crystal structre and lattice parameter of thin films, to determine surface morphology and chemical composition of the $Sn(Se_{0.2}Te_{0.8})$ thin flms formed. The technique used in the crystal growing process was the Vacuum Evaporation technique. The growth of $Sn(Se_{0.2}Te_{0.8})$ thin flms was done by varying the spacer. For sample 1 at spacer 10 cm, sample 2 at spacer 15cm and sample 3 at spacer 25 cm. These $Sn(Se_{0.2}Te_{0.8})$ thin films were characterized by XRD (X-Ray Diffraction) to determine the crystal structure and lattice paremeter, SEM (Scanning Electron Microscopy) to determine surface morphology and EDS (Energy Dispersive Spectrometry) to determine chemical composition of $Sn(Se_{0.2}Te_{0,8})$ thin films. The reults of XRD characterization showed that $Sn(Se_{0.2}Te_{0.8})$ thin films were kubic crystal structure. Lattice parameter of sample 1 is a = 6.34 Å, sample 2 is a = 6.38 Å and sample 3 is a = 6,40 Å. The results of difractograms showed that spacer variation can be effect of crystal quality $Sn(Se_{0.2}Te_{0.8})$. The highest intensity showed in sample 1 with spacer 10 cm, the medium intensity showed in sample 2 with spacer 15 cm and the most low intensity showed in sample 3 with spacer 25 cm. the highest intensity which showed the regularity of atoms. The results of SEM characterization showed that the surface morphology of $Sn(Se_{0.2}Te_{0.8})$ thin films consisted of kubic grains and had homogeneous structure marked by the uniformity of shape and colour. In sample 1, the grains most of the measuring 0,3 µm and sample 2, the grains most of the measuring 0,2 μ m. The results of EDS at sample 1 the molarity comparisons was Sn: Se: Te = 1:0,29:0,58. For the sample 2, the molarity comparisons was Sn:Se:Te = 1:0,33:0,62.

Keywords: $Sn(Se_{0.2}Te_{0.8})$ thin films, vacuum evaporation, preparation, spacer.

.

PENDAHULUAN

Teknologi pada era globalisasi saat ini berkembang sangat pesat. Bagi negara negara maju, teknologi merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan. Hampir seluruh didunia ini menggunakan penduduk teknologi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari. Menurut Syamsul (2005), perkembangan teknologi dalam bidang elektronika yang semakin cepat telah memicu perkembangan bidang informasi secara global. Hal tersebut juga diperkuat beberapa dengan adanya penemuan, penelitian serta pengembangan bahan material semikonduktor lapisan tipis yang banyak digunakan sebagai material dasar dalam pembuatan piranti elektronika yang sesuai dengan aplikasinya.

Pada penelitian ini, bahan material yang digunakan adalah bahan semikonduktor SnTe yang di doping dengan Sellenium (Se). Bahan Se dan Te memiliki kesamaan yaitu merupakan golongan VI A, sedangkan bahan Sn merupakan golongan IV A. Bahan paduan SnSe memiliki energy gap sebesar 1,92 eV pada suhu kamar dan cocok digunakan sebagai aplikasi sel surya (Solanki, dkk 2015). Sedangkan bahan paduan SnTe memliki energy gap sekitar 0,35 eV dan digunakan sebagai detektor inframerah. (Saini,2010). Dalam penelitian ini, bahan digunakan adalah yang semikonduktor $Sn(Se_{0.2}Te_{0.8})$ untuk membuat lapisan tipis dengan perbandingan molaritas Sn: Se: Te adalah 1:0,2:0,8. Doping yang dilakukan yaitu doping Se pada semikonduktor SnTe. Diharapkan dapat terjadi penambahan energy gap dengan nilai antara 0,35eV sampai 1,92 eV, yang kemudian dapat digunakan untuk bahan optoelektronika (Saini, 2010; 1).

Dalam teknologi fabrikasi lapisan tipis secara global dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu *Physical* Vapor Deposition (PVD) dan Chemical Vapor Deposition (CVD). Kelompok PVD meliputi Teknik Vakum Evaporasi, Sputtering dan Closed Space Vapor Transport (CSVT). Sedangkan kelompok **CVD** meliputi Metalorganic Chemical Vapor Deposition (MOCVD), Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition (PECVD), Low Pressure Chemical Vapor Deposition (LPCVD) dan Photo Chemical Vapor Deposition (PCVD). (Milton Ohring, 2002: 96).

Penelitian ini melakukan preparasi lapisan tipis dengan teknik evaporasi vakum yang merupakan kelompok dari *Physical Vapor Deposition* (PVD). Pada teknik ini, pemvakuman tabung dilakukan untuk memperbesar ruang bebas molekul gas untuk menjaga tidak terjadi proses oksidasi.

Kelebihan dari metode ini yaitu hasil preparasi yang dihasilkan lebih baik dan merata pada permukaan substrat.

Setelah lapisan tipis terbentuk, dilakukan karaterisasi menggunakan X-ray (XRD) Diffraction untuk mengetahui struktur kirstal dan parameter kisi, SEM (Scanning electron Microscopy) digunakan untuk mengetahui morfologi bahan dan EDS (Energy Dispersive *Spectroscopy*) digunakan untuk mengetahui komposisi kimia bahan Dari hasil karakterisasi tersebut, dapat diketahui pengaruh spacer terhadap kualitas kristal lapisan tipis yang terbentuk.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2016 sampai dengan bulan April 2017 di Laboratorium Fisika Material UNY, Laboratorium Kimia Organik FMIPA UNY, dan Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu (LPPT) Unit I Universitas Gadjah Mada.

Langkah Penelitian

Penelitian ini meliputi 2 tahap, yaitu tahap preparasi dan tahap karakterisasi. Tahap preparasi merupakan tahap penumbuhan lapisan tipis Sn(Se_{0,2}Te_{0,8})

menggunakan teknik evaporasi vakum yang bekerja pada tekanan (10⁻⁵) mbar. Bahan divakumkan hingga mengalami evaporasi terbentuk lapisan tipis $Sn(Se_{0.2}Te_{0.8}).$ Parameter yang divariasi dalam penelitian ini adalah *spacer* (jarak material dengan substrat menggunakan penyangga). Variasi spacer yang dilakukan yaitu 10 cm, 15 cm dan 25 cm. Tahap karakterisasi lapisan tipis yang terbentuk menggunakan 3 metode yaitu XRD untuk mengetahui struktur kristal dan parameter kisi, SEM digunakan untuk mengetahui morfologi permukaan dan EDS digunakan untuk mengetahui komposisi kimia dari bahan lapisan tipis terbentuk.

Teknik Analisis Data

Hasil XRD berupa difraktogram. Kemudian dilakukan pencocokan data penelitian dengan data standar JCPDS (Joint Committe on Powder Diffraction Standard) sehingga diperoleh struktur kristal. Parameter kisi kristal lapisan tipis ditentukan dengan metode analitik. Hasil karakterisasi SEM berupa foto morfologi permukaan lapisan tipis. Dari foto tersebut dapat diamati bentuk dan ukuran butiranbutiran (grain) melalui berbagai perbesaran. Hasil dari karakterisasi EDS berupa spektrum yang menunjukkan hubungan antara intensitas terhadap energi. Dari spektrum dapat diketahui kmposisi kimia dari bahan lapisan tipis yang terbentuk.

HASIL DAN PEMBAHASAN $\label{eq:hasil} \mbox{ Hasil Karakterisasi Lapisan Tipis } \\ Sn(Se_{0,2}Te_{0,8})$

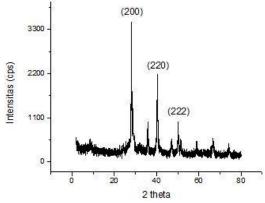
Dalam penelitian dihasilkan tiga sampel lapisan tipis Sn(Se_{0,2}Te_{0,8}) hasil preparasi dengan teknik evaporasi vakum. Parameter yang divariasi yaitu *spacer* atau jarak antara sumber material dengan substrat.

Karakterisasi dengan XRD (*X-Ray Diffraction*) digunakan untuk mengetahui struktur kristal dan parameter kisi lapisan tipis $Sn(Se_{0,2}Te_{0,8})$. Data yang dihasilkan dari karaktersasi XRD ketiga sampel lapisan tipis $Sn(Se_{0,2}Te_{0,8})$ berupa *difraktogram*, yaitu grafik antara intensitas (I) puncak spektrum dan sudut hamburan (2θ) yang ditunjukkan pada Gambar 1, 2, 3 dan 4.

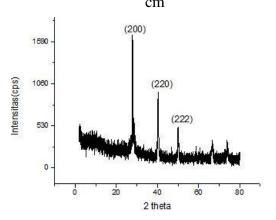
Pada Gambar 4 merupakan gabungan difraktogram lapisan tipis $Sn(Se_{0,2}Te_{0,8})$ dari sampel 1, sampel 2 dan sampel 3. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam membandingkan ketiga sampel tersebut. Gambar 4 menunjukkan perbedaan intensitas dari ketiga sampel. Intensitas atau puncak pada difraktogram menunjukkan keteraturan atom-atom pada kristal lapisan

tipis. Semakin tinggi nilai intensitas yang dihasilkan, maka semakin baik keteraturan atom-atom pada lapisan tipis. Berdasarkan Gambar 4 intensitas tertinggi ditunjukkan pada sampel 1 dengan spacer 10 cm, intensitas sedang ditunjukkan pada sampel 2 dengan spacer 15 cm dan intensitas terendah ditunjukkan pada sampel 3 dengan spacer 25 cm. Sehingga dapat diikatakan bahwa variasi nilai *spacer* berpengaruh terhadap tipis yang terbentuk kualitas lapisan mengacu dari hasil XRD. Maka dari ketiga sampel yang memiliki susunan atom lebih teratur adalah sampel 1 dengan *spacer* 10 cm, karena memiliki intensitas puncak yang paling tinggi.

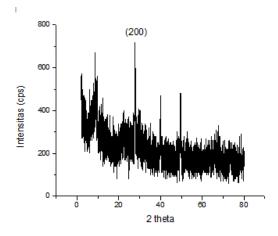
Data yang telah dihasilkan dari karaterisasi XRD kemudian dicocokkan dengan data standar JCPDS (*Joint Commite on Powder Diffraction Standard*) dari SnTe, karena komposisi Te yang lebih besar dari Se. Setelah dilakukan pencocokan data diperoleh informasi sampel lapisan tipis Sn(Se_{0,2}Te_{0,8}) memiliki struktur kristal kubik pusat badan.



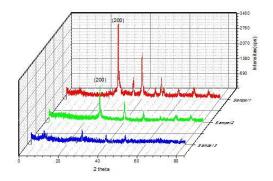
Gambar 1. Difraktogram lapisan tipis $Sn(Se_{0,2}Te_{0,8})$ sampel 1 dengan spacer 10



Gambar 2. Difaktogram lapisan tipis Sn(Se_{0,2}Te_{0,8}) sampel 2 dengan spacer 15



Gambar 3. Difraktogram lapisan tipis $Sn(Se_{0,2}Te_{0,8})$ sampel 3 dengan *spacer* 25



Gambar 4. Difraktogram lapisan tipis $Sn(Se_{0,2}Te_{0,8})$ sampel 1, sampel 2 dan sampel 3

Analisis Parameter Kisi

Penentuan parameter kisi kristal lapisan $Sn(Se_{0.2}Te_{0.8})$ tipis dilakukan dengan metode perhitungan analitik. Data dari karakterisasi **XRD** dibandingkan dengan data JCPDS untuk mengetahui Indeks Miller (hkl) pada puncak-puncak difraksi yang terbentuk pada difraktogram. Data XRD lapisan Tipis $Sn(Se_{0.2}Te_{0.8})$ dengan data JCPDS SnTe disaijakan pada Tabel 1, 2 dan 3.

Tabel 1. Perbandingan data XRD lapisan tipis $Sn(Se_{0,2}Te_{0,8})$ sampel 1 (*spacer* 10 cm) dengan data JCPDS SnTe.

	$Sn(Se_{0,2}Te_{0,8})$		JCPDS Bahan		
Peak	sampel 1		Sn Te		hkl
	I I		I		
	2θ (°)	Relatif	2θ (°)	Relatif	
1	27,947	100	28,309	100	200
2	40,20	72	40,415	50	220
3	50,23	29	50,019	16	222
4	66,70	28	66,227	16	420
5	73,88	23	73,526	8	422

Tabel 2. Perbandingan data XRD lapisan tipis $Sn(Se_{0.2}Te_{0.8})$ sampel 2 (spacer 15 cm) dengan data JCPDS SnTe.

	$Sn(Se_{0,2}Te_{0,8})$		JCPDS Bahan		
sa		pel 2	Sn Te		hkl
Peak		I	I		
	2θ (°)	Relatif	2θ (°)	Relatif	
1	28,129	100	28,309	100	200
2	40,33	128	40,415	50	220
3	50,183	41	50,019	16	222
4	58,84	14	58,477	10	400
5	66,58	29	66,227	16	420

Tabel 3. Perbandingan data XRD lapisan tipis $Sn(Se_{0.2}Te_{0.8})$ sampel 3 (spacer 25 cm) dengan data JCPDS SnTe.

	$Sn(Se_{0,2}Te_{0,8})$		JCPDS Bahan			
Peak	sampel 2		Sn Te		hkl	
	2θ	I		I		
	(°)	Relatif	2θ (°)	Relatif		
1	27,84	100	28,309	100	200	

Berdasarkan Tebel 1, 2 dan 3 diatas nilai hkl yang diperoleh dari JCPDS dapat digunakan untuk menentukan parameter kisi lapisan tipis Sn(Se_{0.2}Te_{0,8}). Metode yang digunakan untuk mementukan parameter kisi lapisan tipis Sn(Se_{0.2}Te_{0,8}) yaitu metode analititk menggunakan persamaan Bragg, sebagai berikut:

$$2 d \sin \theta = n\lambda \tag{1}$$

$$\frac{1}{d^2} = \frac{h^2 + k^2 + l^2}{a^2} \tag{2}$$

Dengan mensubstitusikan persamaan (2) ke persamaan (1)

$$d = \frac{\lambda}{2\sin\theta} \tag{3}$$

$$\frac{4\sin^2\theta A}{\lambda^2} = \frac{h^2 + k^2 + l^2}{a^2}$$
 (4)

Maka,

$$sin^2\theta = \frac{\lambda^2}{4a^2}(h^2 + k + l^2), A = \frac{\lambda^2}{4a^2}$$
 (5)
 $sin^2\theta = A(h^2 + k + l^2)$ (6)

$$\sin^2\theta = A (h^2 + k + l^2) \tag{6}$$

$$A = \frac{\lambda^2}{4a^2} \tag{7}$$

$$a = \frac{\lambda}{\sqrt{4A}} \tag{8}$$

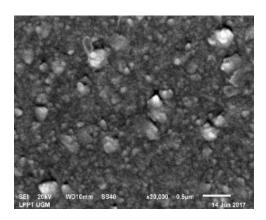
setelah dilakukan perhitungan secara analitik, diperoleh informasi parameter kisi lapisan tipis $Sn(Se_{0,2}Te_{0,8})$ pada Tabel 4.

Tabel 4. Paramater kisi lapisan tipis $Sn(Se_{0,2}Te_{0,8})$ sampel 1, 2, dan 3 dengan data JCPDS

Berdasarkan tabel 4 diatas, dapat diketahui bahwa nilai parameter kisi lapisan tipis $Sn(Se_{0,2}Te_{0,8})$ dari hasil analisis dan data JCPDS tidak jauh berbeda, sehingga dapat dikatakan bahwa variasi *spacer* tidak mempengaruhi parameter kisi dan struktur kristal lapisan tipis $Sn(Se_{0,2}Te_{0,8})$.

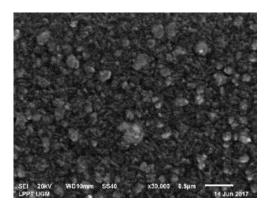
Morfologi Permukaan Hasil SEM

Karakterisasi hasil SEM yaitu berupa foto morfologi permukaan dari lapisan yang terbentuk. Untuk foto morfologi permukaan sampel 1 dengan spacer 10 cm disajikan pada gambar 5 dengan perbesaran 15.000 kali dan 30.000 kali.



Gambar 5. Foto morfologi permukaan lapisan tipis Sn(Se_{0,2}Te_{0,8}) hasil SEM sampel 1 dengan perbesaran 30.000 kali.

Untuk foto morfologi permukaan sampel 1 dengan spacer 15 cm disajikan pada Gambar 6 dengan perbesaran 15.000 kali dan 30.000 kali.



Gambar 6. Foto morfologi permukaan lapisan tipis Sn(Se_{0,2}Te_{0,8}) hasil SEM sampel 2 dengan perbesaran 30.000 kali.

Berdasarkan foto yang dihasilkan dari karakterisai SEM pada Gambar 5 untuk sampel 1 dan Gambar 6 untuk sampel 2, dengan perbesaran 30.000 kali terlihat morfologi permukaan dari kedua sampel tersusun atas butiran-butiran (grain) yang berbentuk kotak-kotak hampir menyerupai kubus, hal ini sesuai dengan struktur kristal

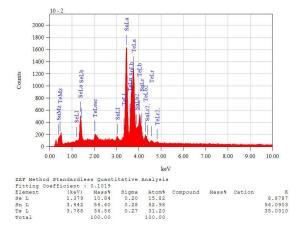
Parameter	Sampe			
kisi	1	2	3	JCPDS
KISI	(10cm)	(15cm)	(25cm)	
a (Å)	6,34	6,38	6,40	6,30

kubik, dimana nilai parameter kisinya sama, yaitu a=b=c. Selain itu juga terlihat morfologi permukaan dari kedua sampel yang seragam ditunjukkan dengan adanya keseragaman warna, ukuran dan bentuk dari

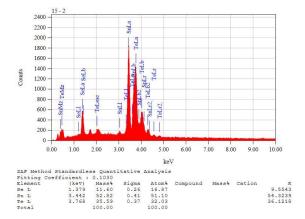
lapisan tipis tersebut. Untuk sampel 1, butiran (grain) sebagian besar berukuran sekitar 0,3 μ m dan untuk sampel 2, butiran (grain) sebagian besar berukuran sekitar 0,2 μ m.

Komposisi Kimia Hasil EDS

Karakterisasi EDS digunakan untuk mengetahui komposisi kimia lapisan tipis Sn(Se_{0.2}Te_{0.8}). Hasil karakterisasi dari EDS berupa spektrum yang menunjukkan hubungan antara energi dengan intensitas, yang menyatakan hasil spektrum energi sinar-X. Dari hasil spektrum tersebut dapat diketahui unsu-unsur yang terkandung dalam bahan diketahui dan dapat perbandingan persentase atom untuk masing-masing unsur penyusun bahan tersebut. Hasil karakterisasi EDS dari sampel 1 dan 2 disajikan pada Gambar 7 dan 8.



Gambar 7. Grafik antara Intensitas dengan Energi Hasil karakterisasi EDS Lapisan tipis Sn(Se_{0.2}Te_{0,8}) sampel 1.



Gambar 8. Grafik antara Intensitas dengan Energi Hasil karakterisasi EDS Lapisan tipis Sn(Se_{0.2}Te_{0,8}) sampel 2.

Berdasarkan Gambar 7 dan 8, dapat diketahui bahwa preparasi lapisan tipis Sn(Se_{0.2}Te_{0.8}) sampel 1 dengan spacer 10 dan sampel 2 dengan spacer 15 cm samasama mengandung unsur Sn (Stannum), Se (Sellenium) dan Te (Tellurium). Untuk dengan sampel spacer perbandingan persentase komposisi kimia unsur penyusunnya, yaitu unsur Sn = 52,98%, Se = 15,82% dan Te = 31,20%. Sedangkan untuk sampel 2 dengan spacer 15 cm, perbandingan persentase komposisi kimia unsur penyusunnya , yaitu Sn = 51,10%, Se = 16,87% dan Te = 32,03%. Untuk perbandingan molaritas unsur Sn, Se dan Te untuk sampel 1 dan sampel 2 dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Perbandingan Molaritas Unsur Sn, Se dan Te lapisan tipis Sn(Se_{0,2}Te_{0,8}) sampel 1 dan sampel 2 hasil karakterisasi EDS dan Teori.

	Perbandi	Perbandi	Perbandi
Unsur	ngan	ngan	ngan
Clisti	Molaritas	Molaritas	Molaritas
	Sampel 1	Sampel 2	Teori
Sn	1	1	1
Se	0,29	0,33	0,2
Te	0,58	0,62	0,8

Berdasarkan Tabel 5, dapat dilihat bahwa komposisi kimia lapisan tipis Sn(Se_{0.2}Te_{0,8}) untuk sampel 1 memiliki perbandingan molaritas dari masing-masing unsur Sn: Se: Te adalah 1: 0,29: 0,58. Untuk sampel 2 memiliki perbandingan molaritas Sn : Se : Te adalah 1 : 0,33 : 0,62. Sedangkan perbandingan molaritas menurut teori adalah Sn : Se : Te adalah 1 : 0,2 : 0,8. Dari hasil karakterisasi EDS, dapat diketahui bahwa terjadi perubahan komposisi kimia dari karakterisasi EDS dengan teori. Ketidaksesuaian itu dapat diindikasikan bahwa bahan tersebut mengalami non stoichiometry. Peristiwa non stoichiometry dapat terjadi ketika proses pemvakuman, saat bahan menguap dari *crucible* menuju substrat tidak menempel dengan sempurna.

KESIMPULAN dan SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1. Proses penumbuhan lapisan tipis Sn(Se_{0.2}Te_{0.8}) hasil teknik evaporasi vakum dengan variasi spacer yang dikarakterisasi dengan XRD dapat mempengaruhi kualitas kristal lapisan tipis, yang ditunjukkan dengan adanya perbedaan intensitas yang diperoleh dari masing-masing variasi spacer. Intensitas paling tinggi ditunjukkan pada sampel 1 dengan spacer 10 cm, intensitas sedang ditunjukkan pada sampel 2 dengan spacer 15 cm dan intensitas paling rendah ditunjukkan pada sampel 3 dengan spacer 25 cm. Intensitas spektrum yang tinggi menunjukkan atom penyusun lapisan tipis memiliki keteraturan yang semakin baik.
- 2. Hasil karakterisasi XRD menunjukkan bahwa variasi *spacer* hasil preparasi dengan teknik evaporasi vakum tidak mempengaruhi struktur kristal maupun parameter kisi lapisan tipis

Sn(Se_{0,2}Te_{0,8}), struktur kristal yang diperoleh adalah kubik dengan nilai parameter kisi sebagai berikut :

- a. Sampel 1 (*spacer* 10 cm), dengan nilai a = b = c = 6,34 Å.
- b. Sampel 2 (*spacer* 15 cm), dengan nilai a = b = c = 6,38 Å.
- c. Sampel 3 (*spacer* 25 cm), dengan nilai a = b = c = 6,40 Å.
- 3. Hasil dari karakterisasi SEM menunjukkan $Sn(Se_{0.2}Te_{0.8})$ bahwa lapisan tipis mempunyai morfologi permukaan yang tersusun atas grain (butiran-butiran) berbentuk kotak-kotak menyerupai kubik dan memiliki permukaan yang homogen terlihat dari bentuk dan warna yang seragam. Pada sampel 1, butiran (grain) sebagian besar berukuran sekitar 0,3 µm dan pada sampel 2, butiran (grain) sebagian besar berukuran sekitar $0.2 \mu m$.
- 4. Hasil karakterisasi EDS menunjukkan sampel 1 dan sampel 2 sama-sama mengandung unsur Sn (*Stannum*), Se (*Sellenium*) dan Te (*Tellurium*). Untuk sampel 1 dengan *spacer* 10 cm, perbandingan persentase komposisi kimia unsur penyusunnya, yaitu unsur Sn = 52,98%, Se = 15,82% dan Te = 31,20%, dan perbandingan molaritasnya adalah Sn: Se: Te = 1:0,29:0,58. Untuk sampel 2 dengan *spacer* 15 cm, perbandingan

persentase komposisi kimia unsur penyusunnya , yaitu Sn=51,10%, Se=16,87% dan Te=32,03%, dan perbandingan molaritasnya adalah Sn:Se:Te=1:0,33:0,62.

Saran

Adapun saran yang disamapikan adalah:

- Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai bahan, seperti konduktivitas dan kelistrikan, agar diperoleh informasi yang lebih banyak tentang lapisan tipis Sn(Se_{0.2}Te_{0.8}).
- Pemvakuman dilakukan sampai tekanan lebih rendah lagi untuk untuk mengurangi adanya oksidasi pada saat preparasi.

DAFTAR PUSTAKA

Ohring, Milton. (2012). *Materials Science of Thin Films Deposition and Structure*.

2th.ed. San Diego: Academic Press.

Saini, R., Pallavi, Singh, M., Kumar, R.,

Jain, G., et.al. (2010). Structural

and Electrical Characterization of

Sinteres Sn Te Films. Jurnal. College

Departement of Physics.

Solanki, GK, Gosain N.N. and Patel K.d.,

Research Journal of Chemical Sciences, Vol 5(3).

Syamsul, Darsikin, Iqbal, Jusman, Winata,

Sukino, Barmawi. (2005).

Penumbuhan Lapisan Tipis µc-Si: H

dengan Sistem Hot Wire PECVD

untuk Aplikasi Divais

Sel Surya. Jurnal Matematika dan Sains, Bandung: ITB

Studi tentang Pengaruh.....(Wida Afosma)397